# TiAl 合金表面阴极微弧制备的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 膜结构与性能

李夕金1,程国安1,薛文斌1,郑瑞廷1,田华1,程云君2

(1. 射线束技术及材料改性教育部重点实验室,北京师范大学 材料科学与工程系,北京 100875;2. 钢铁研究总院 TiAl 系金属间化合物研究中心,北京,100081)

**摘 要**: 以 Al(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>乙醇溶液为电解液,采用阴极微弧放电沉积方法,在 TiAl 合金表面制备连续的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>薄膜, 并对膜的结构与性能进行研究。利用扫描电镜(SEM)观察到样品表面分布着熔融状颗粒,颗粒的平均直径约 20 μm,颗粒中间有小孔存在。X 射线衍射(XRD)分析表明氧化膜的相成分主要为 α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 和 γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 相,还有少量的 ε-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 相;氧化膜中 α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 和 γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的相对含量随着制备电压改变而变化。显微划痕实验测得膜与 TiAl 基体 之间结合力大于 20 N,表明制得的氧化膜与基体有良好的结合力。900 ℃的高温氧化实验表明氧化膜能够有效地 提高基体的抗氧化性能。

关键词: 阴极微弧沉积; TiAl 合金; Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 膜; 高温氧化
中图分类号: TG 146.2; TG 174.45
文献标识码: A
文章编号: 1673-0224(2009)2-115-04

# Structure and Properties of Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> coating fabricated by cathodic microarc deposition on TiAl alloy

LI Xi-jin<sup>1</sup>, CHENG Guo-an<sup>1</sup>, XUE Wen-bin<sup>1</sup>, ZHENG Rui-ting<sup>1</sup>, TIAN Hua<sup>1</sup>, CHENG Yun-jun<sup>2</sup>

 Key Laboratory of Beam Technology and Material Modification of Ministry of Education, Department of Materials Science & Engineering, Beijing Normal University, Beijing 100875, China;

2. Research Center of Ti-Al Intermetallic Compound, High Temperature Material Research Division, General Iron & Steel Research Institute, Beijing 100081, China)

**Abstract:** Continuous Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> coating was fabricated on TiAl alloy by cathodic microarc deposition method with Al(NO<sub>2</sub>)<sub>3</sub> ethanol solution as electrolyte. Morphology and constitution structure were analyzed by X-ray diffraction (XRD) and scanning electronic microscope (SEM). The experimental results showed that the coating is mainly consisted of  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> phases besides low contents of  $\varepsilon$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> phase, the adhesive force between the coating and substrate is over 20 N measured by micro-scratch tester. Isothermal oxidation at 900 °C revealed that the oxidation resistance of the coated TiAl is improved.

Key words: cathodic microarc deposition; TiAl alloy; Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> coating; isothermal oxidation

TiAl 合金具有密度小、比强度和比刚度高、高温 抗氧化性能好等特性,在航天航空领域有着越来越多 的应用<sup>[1-2]</sup>。但是,TiAl 合金存在室温耐磨性差,摩 擦因数大等缺点,特别是在 700 ℃以上抗氧化性不 足,限制了该合金在高温下的进一步应用。已有多种 表面处理技术用来提高 TiAl 合金的性能,如阳极氧化处理<sup>[3]</sup>、低氧压氧化预处理<sup>[4]</sup>以及离子注入等<sup>[5-6]</sup>。但这些处理方法技术要求高、膜的厚度和膜基结合力不能兼顾,从而限制了其推广与应用。微弧氧化技术可以在 Ti、Al、Mg 等金属表面制备与基体结合良好的

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(10575011)

收稿日期: 2008-10-28; 修订日期: 2008-12-18

通讯作者: 程国安, 电话: 010-62205403; 传真: 010-62205403; E-mail: gacheng@bnu.edu.cn

陶瓷膜<sup>[7-8]</sup>,由于基体金属参与成膜过程,制得的主要 是 Al<sub>2</sub>TiO<sub>5</sub>相为主的陶瓷膜。Al<sub>2</sub>TiO<sub>5</sub>在 900 ℃以上容 易分解,失去对基体合金的保护作用<sup>[9]</sup>。电沉积是一 种简单、经济的表面处理技术,但制备的薄膜与基体 结合力不高。阴极微弧放电沉积是将电沉积技术和微 弧技术结合在一起的一种新颖的表面处理技术,它结 合了这 2 种技术的优点<sup>[10-11]</sup>。利用电沉积技术制备薄 膜可以不受基体金属的影响,在合金表面形成连续的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 膜。同时在微弧放电过程中,基体金属在膜/基 界面处参与 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的成膜过程,可使膜层与基体形成 良好的结合。本文作者利用 TiAl 合金作为阴极,在 Al(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> 乙醇溶液中制备与基体具有良好结合力的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 膜,并分析膜的结构与性能。

## 1 实验

实验用的 TiAl 合金成分是 Ti48Al2Cr2Nb(数据为 原子分数,%)。合金样品经线切割加工成尺寸为 18 mm×12 mm×3 mm 的样品,从 100<sup>#</sup>SiC 砂纸开始, 依次磨至 600<sup>#</sup>。再经丙酮溶液和去离子水清洗、干燥 后,放入预先配制好的电解液中进行微弧沉积处理。 所用的电解液为含 Al(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> 的乙醇溶液,Al(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> 的 浓度为 0.4 mol/L。以 TiAl 基体作为阴极、不锈钢容 器为阳极,在两电极之间施加脉冲电压,保持阴极电 压不变。实验过程中注意观察样品表面的火花大小, 防止大的破坏性火花出现。通过水冷方式控制电解液 的温度不超过 60 ℃。30 min 后取出表面沉积有 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 薄膜的 TiAl 合金样品,用去离子水冲洗、干燥。

用无损涡流测厚仪测量样品厚度,利用型号为 Hitathi S-4800的扫描电镜(SEM)观察膜的表面形貌, 借助 X' Pert 型 X 射线衍射仪(XRD)分析膜层的相组 成。通过 HV-1000 维氏显微硬度计测量膜的硬度, 所 用载荷为25g。通过显微划痕试验测定膜与基体的结 合力,试验所用最大载荷为40N,加载速度25N/min。 膜破裂时产生超声信号,将产生超声信号时的载荷值 作为膜/基结合力的大小。高温氧化实验在 900 ℃空 气气氛下进行,为了减少升温和降温过程中热应力对 膜层的影响,升温速度和降温速度定为 200 ℃/h。热 氧化时间不包括升温时间和降温时间。保温到设定时 间后将样品取出,利用精度为 0.1 g 的电子分析天平 测量样品质量的增加量。作为对比,将没有膜保护的 TiAl基体与有膜的样品放在同一高温炉中同步加热氧 化。测量完成后,将盛有样品的坩埚再次放入炉中升 温加热,直至总的氧化时间为100h。

# 2 结果与分析

#### 2.1 样品形貌

实验开始,首先在样品表面有气泡出现。随着电 压升高,微小的火花在样品表面出现并移动,5 min 后火花逐渐变大,变密。经过15 min 处理,火花数目 开始减少。微弧电沉积处理30 min 的样品表面 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 陶瓷膜的厚度为80 μm,膜层表面 SEM 形貌如图1所 示。样品表面分布着熔融状颗粒,颗粒的平均直径约 20 μm,颗粒中间有小孔存在。这些小孔是在微弧放 电过程中的放电孔道。从放大的照片图1(b)中可以看 出小孔的边缘光滑,孔的直径大约在3~5 μm 之间。 同时在膜的表面存在直径约10~20 μm 的少量大孔, 是沉积后期火花较大时的放电孔道。膜表面有裂纹出 现,如图1(b)中箭头所指方格中的裂纹。应该是沉积 过程中热应力作用的结果。



图 1 膜层的表面形貌 Fig.1 Morphology of coating

在两极施加电压后,Al离子向阴极表面移动,并 有部分 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 生成,对乙醇分解起催化作用。在电解 液和 TiAl 基体表面有式(1)~(6)所示的反应发生,氢气 从阴极表面析出。当析出的氢气覆盖整个样品表面时, 在样品表面形成氢气泡薄层。此时两极间电压主要降 落在这一薄层上,使薄层内的场强迅速增大。当场强 足以击穿氢气泡薄层时,微弱的火花在样品表面出现。 电泳沉积在阴极表面的 Al(OH)3 在火花区的高温作用 下,熔融并生成 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,熔融物沿着放电通道喷出后 遇到冷的电解液,凝固在样品表面。火花的位置在样 品表面不断移动,膜的厚度不断增加。

$$CH_{3}CH_{2}OH+CH_{3}CH_{2}OH \xrightarrow{240 \ ^{\circ}CAl_{2}O_{3}} \rightarrow CH_{3}CH_{2}OCH_{2}CH_{3}+H_{2}O \qquad (1)$$

$$CH_{3}CH_{2}OH \xrightarrow{360 \ ^{\circ}C \ Al_{2}O_{3}} \rightarrow CH_{2} = CH_{2}+H_{2}O \qquad (2)$$

$$2H_{2}O+2e \rightarrow H_{2}\uparrow+2OH^{-} \qquad (3)$$

$$Al^{3+}+3OH^{-}\rightarrow Al(OH)_{3} \downarrow \qquad (4)$$

$$Al(OH)_{3}\rightarrow Al_{2}O_{3}+H_{2}O \qquad (5)$$

$$Al(NO_{3})_{3} \xrightarrow{\Delta} Al_{2}O_{3}+NO_{x} \qquad (6)$$

#### 2.2 膜层的物相组成

膜层的 XRD 谱如图 2 所示。膜层主要由 γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 和 α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相组成,还有少量的不稳定相 ε-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>。随 着电压升高,α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相的含量增加。由于火花放电作 用,样品表面局部温度很高,沉积在 TiAl 基体表面的 Al(OH)<sub>3</sub> 脱水形成熔融态的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,液态的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>沿着 放电通道向外喷出,在通道外与电解液相遇并迅速冷 却。由于高的凝固速率有利于 γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相的形成,因此 膜中 γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相的含量很高。膜的内层离电解液较远, 在火花放电的作用下,温度很高,促使 γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相转化 为 α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相。随着电压升高,放电微弧区的温度升 高,导致更多的 γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相转化为 α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相。在 XRD 谱中没有发现 TiAl 基体相的成份,表明膜的厚度较 大,对基体的覆盖效果好。



cathodic microarc at 300 V (a) and 400V (b)

#### 2.3 膜与基体的结合力

通过显微划痕试验测定陶瓷膜与基体之间的结合 力,结果如图 3 所示。图中显示在大约 20 N 附近出现 超声信号。与典型的脆性开裂不同,试验中只出现了 1 条信号线,这可能与膜层的多孔结构有关。Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 膜是在电沉积和微弧放电的共同作用下形成的,由于 微弧放电作用,界面附近的基体金属参与成膜过程, 因此制得的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 膜与基体之间形成很好的结合。划 痕仪的金刚石压头在从膜层进入基体时两相界面处有 超声信号出现。但是由于膜层的多孔结构以及韧性的 y-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相的存在, 膜层被压头划开, 继续加载的过程 中,没有相应的超声信号出现,表明膜/基之间的结合 是良好的冶金结合。划痕表面 SEM 形貌如图 4 所示, 划痕从右向左扩展,在其中部有白色的区域出现,表 明膜层开始划穿。在划痕的左侧,压痕非常明显,但 是与基体之间结合良好,显示膜的韧性良好。由显微 硬度计测得膜的硬度为 HV1 100, 远高于 TiAl 基体的 硬度 HV360, 说明薄膜具有很好的强度。



图 3 TiAl 基体表面 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>膜的超声划痕信号 Fig.3 Ultrasonic signal of scratch for Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> coatings.



图 4 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 膜划痕的表面形貌 Fig.4 Morphology of the scratch on Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> coating

#### 2.4 高温氧化动力学

图 5 所示是 TiAl 基体和基体表面的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 膜在

900 ℃的空气环境中质量随氧化时间的变化曲线。图 5 表明氧化过程中的质量变化可以分为 2 个阶段,前 期质量增加较快,说明氧化速度较快。后期氧化速度 明显变慢。在氧化时间 50 h 以内,无膜 TiAl 合金的 质量增加较快,大约为 3.1×10<sup>-7</sup> g/(mm<sup>2</sup>·h),而有膜的 TiAl 基体的质量增加速率只有 1.7×10<sup>-7</sup> g/(mm<sup>2</sup>·h)。氧 化后期 TiAl 基体的质量增加速度下降为 8.3×10<sup>-8</sup> g/(mm<sup>2</sup>·h),在 100 h 氧化后质量有继续增加的趋势, 而有膜基体在氧化 75 h 后质量增加几乎为零,说明阴 极微弧沉积制备的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 膜对基体具有较好的保护 作用。



TiAl 合金在高温氧化过程中,氧化动力学曲线基本符合抛物线规律,合金表面形成的氧化膜对基体起保护作用,但由于 TiAl 合金的氧化产物主要是金红石和 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 相,其抗氧化能力比 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 弱。有 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 膜保护的样品表面形成了连续、致密的膜层,有效阻挡了氧离子向膜内的扩散,其抗氧化能力高于基体合金。

### 3 结论

1) 在1 400 V 的脉冲直流电压下 30 min 阴极微 弧沉积可以在 TiAl 合金表面制得厚度达 80 μm 的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷膜,该陶瓷膜具有多孔结构。

 陶瓷膜主要由 γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 和 α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 相组成, 韧性
 的 γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 相含量较多。此外还有少量的不稳定相 ε-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>。随着电压升高, α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 相的含量增加。

3) 膜的硬度达到HV1100,高于TiAl基体的硬度, 膜与基体的结合力超过20N。 4) 900 ℃高温氧化动力学实验结果表明,制备的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 陶瓷膜可有效提高基体的抗氧化性能。

#### REFERENCES

- AUSTIN C M. Current status of gamma Ti aluminides for aerospace applications[J]. Curr Opin Solid State Mater. Sci. 1999, 4(3): 239–242.
- [2] LORIA E A. Gamma titanium aluminides as prospective structural materials[J]. Intermetallics, 2008, 8(9/11): 1339–1345.
- [3] KURANISHI T, HABAZAKI H, KONNO H. Oxidation-resistant multilayer coatings using an anodic alumina layer as a diffusion barrier on g-TiAl[J]. Surface & Coatings Technology, 2005, 200(7): 2438–2444.
- [4] 曲恒磊,周 廉,魏海荣.低压预处理对TiAl抗氧化性的影响
  [J].腐蚀科学与防护技术,2000,12(5):280-283.
  QU Heng-lei, ZHOU Lian, WEI hai-rong. Effect of low oxygen partial pressure pretreatment on interrupted oxidation behavior of TiAl-based alloys[J]. Corrosion Science and Protection Technology, 2000, 12(5): 280-283.
- [5] STROOSNIJDER M F, ZHEND N, QUADAKKERS W J, et al. The effect of niobium ion implantation on the oxidation behavior of a *γ*-TiAI-based intermetallic[J]. Oxid Met, 1996, 46(1/2): 19– 35.
- [6] TANIGUCHI S, UESAKI K, ZHU Y C, et al. Influence of implantation of Al, Si, Cr or Mo ions on the oxidation behaviour of TiAl under thermal cycle conditions[J]. Mater Sci Eng A, 1999, 266(1/2): 267–275.
- [7] YEROKHIN A L, NIE X, LEYLAND A, et al. Plasma electrolysis for surface engineering[J]. Surface & Coatings Technology, 1999, 122(2/3): 73–93.
- [8] XUE Wen-bin, DENG Zhi-wei, LAI Yong-chun, et al. Analysis of phase distribution for ceramic coatings formed by microarc oxidation on aluminum alloy[J]. Am Ceramic Soc, 1998, 81(5): 1365–1368.
- [9] LI Xi-jin, WU Xiao-ling, XUE Wen-bin, et al. Structures and properties of ceramic films on TiAl intermetallic compound fabricated by microarc oxidation[J]. Surface & Coatings Technology, 2007, 201(9/11): 5556–5559.
- [10] 李新梅,李银锁,憨 勇. 钛表面阴极微弧电沉积制备氧化铝 涂层[J]. 无机材料学报, 2005, 20(6): 1493-1499.
  LI Xin-mei, LI Yin-suo, HAN Yong. Preparation of alumina coatings on titanium by cathodic micro-arc electrodeposition[J]. Journal of Inorganic Materials, 2005, 20(6): 1493-1499.
- [11] 韩 伟,何业东,王德仁,等. 阴极气膜微弧放电沉积 ZrO<sub>2</sub>-Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷涂层[J]. 稀有金属,2004,28(4):622-626.
  HAN Wei, HE Ye-dong, WANG De-ren, et al. ZrO<sub>2</sub>-Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> coating prepared by cathodic plasma electrolysis deposition[J]. Chinese Journal of Rare Metals, 2004, 28(4): 622-626.

(编辑 汤金芝)